

半導体製造体験

講師

九州大学 大学院総合理工学研究院
半導体・デバイスエコシステム研究教育センター
教授 佐道 泰造 氏

今年も
2回開催

半導体の製造におけるリソグラフィ工程（レジスト塗布/露光・現像/エッチング）を九州大学のクリーンルームにて1日で体験します。初級レベルの講座です。半導体関連業務に従事していても実際の製造現場を知らない方にお勧めします。

【概要】PチャネルMOSFETをシリコン基板上に集積化した論理回路(NAND)を例題として取り上げ、集積回路(IC)製造プロセスの一部(リソグラフィ工程)を行うとともに、MOSFETと論理回路の動作特性を計測・評価します。

1. IC製造プロセス（講義）
2. 実習に用いる装置・材料の説明（講義）
3. IC製造（実習）

クリーンルームにて
(1) レジスト塗布
(2) 露光・現像
(3) エッチング



4. ICの計測（実習）
(1) MOSFETのしきい値電圧の評価
(2) NAND回路の動作特性の計測
5. データ整理とまとめ
PC（センターで準備）を使ってデータ整理を行い、発表していただきます

※一部変更になる場合がございます



※実習について、「3. IC製造（実習）」と「4. ICの計測（実習）」とは2グループに分かれて午前と午後で実習内容を入れ替えながら実施します。

※クリーンルームでは防塵服を着用します。手続き簡略化のためサイズはLL(身長～182cm、胸囲～112cm)に統一させていただきます。なお防塵服着用のためスカートでの参加はご遠慮ください。

【1回目】2025年 11月21日(金) 10:00～17:00

【2回目】2025年 11月26日(水) 10:00～17:00

お申込み期間は 2025年9月25日(木) 9:00から 2025年11月18日(火) 17:00 までとなります。

受講料 33,000円(税込)

対面受講のみ・実習中心

定員 【1回目】8名 / 【2回目】8名

【1回目】と【2回目】は同じ内容です。
どちらかをお申し込みください。



●受講会場
〒819-0395 福岡市西区元岡744
九州大学伊都キャンパス
ウエスト2号館
5階 547号室(第2会議室)



●お申込み方法

ふくおかIST e-learning のホームページより、「講座・セミナー等 申込」をクリックし、「半導体製造体験」からお申込ください。

ふくおかIST e-learning

検索

本講座に関するお問合せは下記までお願いいたします。

e-mail : reskilling_contact@ist.or.jp TEL 092-822-1550

公益財団法人 福岡県産業・科学技術振興財団
福岡半導体リスキリングセンター 事務局

- お申込みには、「ふくおかIST e-learning」への会員登録が必要です。 ■ お支払い後、当日の参加有無にかかわらず返金はいたしません。
- 福岡県内中小企業の方には、受講料補助制度があります。 ■ 特段の事情が発生した場合、やむを得ず中止、又は延期する場合がございます。
- 会場にて全受講者に紙テキストを配布します。 ※テキストの無断転載・複製等は禁止しています。

福岡県内
中小企業の方は

受講料全額補助

※消費税及び地方消費税を除く



詳細はこちら

補助には条件がございます。
お申込みの前に福岡半導体リスキリングセンターのホームページから、申請要領・交付要綱をご確認ください。

